

PCT/JP2004/010608

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

27.07.2004

JP04/10608

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2003年 7月29日

出願番号
Application Number: 特願2003-281533
[ST. 10/C]: [JP2003-281533]

出願人
Applicant(s): 株式会社東京大学TLO

REC'D 16 SEP 2004
WIPO PCT

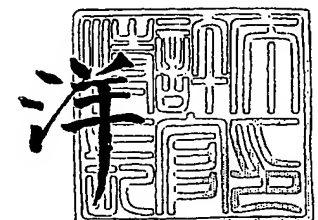
**PRIORITY
DOCUMENT**
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1 (a) OR (b)

BEST AVAILABLE COPY

2004年 9月 2日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小川



【書類名】 特許願
【整理番号】 CAP03012
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 G01B 11/30
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都三鷹市井の頭 1-24-3
 【氏名】 宮野 健次郎
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都世田谷区三宿 2-11-23 ルラシオン三宿 302号
 【氏名】 小川 直毅
【特許出願人】
 【住所又は居所】 東京都三鷹市井の頭 1-24-3
 【氏名又は名称】 宮野 健次郎
【特許出願人】
 【住所又は居所】 東京都世田谷区三宿 2-11-23 ルラシオン三宿 302号
 【氏名又は名称】 小川 直毅
【代理人】
 【識別番号】 100091904
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 成瀬 重雄
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 054391
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1

【書類名】 特許請求の範囲**【請求項 1】**

カンチレバーと、発光部と、受光部とを備え、前記発光部は、発光素子と入力用導光体とを備え、前記入力用導光体は、前記発光素子からの光を前記カンチレバーの表面に向けて照射する構成となっており、前記受光部は、出力用導光体と受光素子とを備え、前記出力用導光体は、前記表面で反射した前記光を前記受光素子に導く構成となっていることを特徴とする走査型プローブ顕微鏡。

【請求項 2】

前記入力用導光体および出力用導光体は、いずれも光ファイバにより構成されていることを特徴とする請求項 1 に記載の走査型プローブ顕微鏡。

【請求項 3】

前記出力用導光体は、複数の光ファイバにより構成されていることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の走査型プローブ顕微鏡。

【請求項 4】

前記複数の光ファイバの先端には、前記カンチレバーからの反射光を前記複数の光ファイバにそれぞれ集光するための略球形状のレンズがそれぞれ配置されており、前記レンズどうしの対向面は、ほぼ平面状とされ、かつ、互いに隣接されていることを特徴とする請求項 3 に記載の走査型プローブ顕微鏡。

【請求項 5】

前記カンチレバーの先端には探針が取り付けられていることを特徴とする請求項 1 ～ 4 のいずれか 1 項に記載の走査型プローブ顕微鏡。

【請求項 6】

前記発光素子はレーザダイオードであることを特徴とする請求項 1 ～ 5 のいずれか 1 項に記載の走査型プローブ顕微鏡。

【請求項 7】

前記受光素子はフォトダイオードであることを特徴とする請求項 1 ～ 6 のいずれか 1 項に記載の走査型プローブ顕微鏡。

【書類名】明細書

【発明の名称】走査型プローブ顕微鏡

【技術分野】

【0001】

本発明は、走査型プローブ顕微鏡に関し、特に、光てこ法を用いた走査型プローブ顕微鏡に関する。

【背景技術】

【0002】

従来から、光てこ法を用いた走査型プローブ顕微鏡が知られている（例えば下記特許文献1や非特許文献1、2を参照）。なお、本明細書においては、走査型プローブ顕微鏡とは、AFM（原子間力顕微鏡）や磁気力顕微鏡など、光てこ法を用いることができる顕微鏡を意味するものとする。また、AFMには、探針を試料表面に接触させない形態と、接触させる形態とがある。この明細書における走査型プローブ顕微鏡は、両形態を含んでいる。

【0003】

このような従来の走査型プローブ顕微鏡（以降の説明ではSPMと略称することがある）では、カンチレバーの表面にレーザ光を照射し、反射光をフォトダイオードで受光する。この受光量の変化に基づいて、カンチレバーの変位を検出することができる。

【0004】

ところで、従来のSPMでは、受光量の増大を図るために、受光素子としてのフォトダイオードをカンチレバーの近傍に配置している。

【0005】

しかしながら、フォトダイオードが試料の近傍にあると、試料に対して極低温、高真空または強磁場のような厳しい環境を与えようとしたときに、この環境がフォトダイオードに影響して測定が難しくなることがある。

【0006】

また、従来のSPMでは、カンチレバーを移動させて試料を走査することが難しいため、試料を移動させる必要があり、このため、装置が大型化したり、大きな試料を用いることが難しいという問題もある。

【0007】

この問題を解決するために、光ファイバ干渉計によりカンチレバーの変位を検出しようとする提案もされている。しかしながら、この方法には、取り扱いが難しいという問題がある。

【0008】

【特許文献1】特開平6-323847号公報

【非特許文献1】Gerhard Meyer and Nabil M. Amer, Appl. Phys. Lett. 53, 1045 (1988)

【非特許文献2】S. Alexander, L. Hellemans, O. Marti, J. Schneir, V. Elings, P. K. Hansma, Matt Longmire, and John Gurley, J. Appl Phys. 65, 164 (1989)

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0009】

本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、厳しい環境下でも使用が容易な走査型プローブ顕微鏡を提供しようとするものである。

【課題を解決するための手段】

【0010】

本発明に係る走査型プローブ顕微鏡は、カンチレバーと、発光部と、受光部とを備えている。前記発光部は、発光素子と入力用導光体とを備えている。前記入力用導光体は、前記発光素子からの光を前記カンチレバーの表面に向けて照射する構成となっている。前記受光部は、出力用導光体と受光素子とを備えている。前記出力用導光体は、前記表面で反

射した前記光を前記受光素子に導く構成となっている。

【0011】

前記入力用導光体および出力用導光体を、いずれも光ファイバにより構成することができる。

【0012】

前記出力用導光体を、複数の光ファイバにより構成することもできる。

【0013】

前記複数の光ファイバの先端に、前記カンチレバーからの反射光を前記複数の光ファイバにそれぞれ集光するための略球形状のレンズをそれぞれ配置してもよい。さらに、前記レンズどうしの対向面をほぼ平面状とし、かつ、互いに隣接させることもできる。

【0014】

前記カンチレバーの先端に探針を取り付けることもできる。

【0015】

前記発光素子をレーザダイオードとしてもよい。

【0016】

前記受光素子をフォトダイオードとしてもよい。

【発明の効果】

【0017】

本発明の走査型プローブ顕微鏡によれば、厳しい環境下でも使用が容易な走査型プローブ顕微鏡を提供することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0018】

(実施形態の構成)

以下、本発明の一実施形態に係る走査型プローブ顕微鏡(SPM)を、図1を参照して説明する。このSPMは、カンチレバー1と、探針2と、発光部3と、受光部4とを備えている。

【0019】

カンチレバー1は、その基部が支持された片持ち梁となっており、先端に加えられた力により先端位置が変位するようになっている。探針2は、カンチレバー1の先端下面に取り付けられている。これらの構成は従来のSPMと同様である。

【0020】

発光部3は、発光素子31と入力用導光体32とレンズ33とを備えている。発光素子31としては、例えばレーザダイオードである。発光素子31は、図示しない回路により駆動されるようになっている。

【0021】

入力用導光体32は、この実施形態では、1本の光ファイバにより構成されている。入力用導光体32は、発光素子31の近傍からレンズ33まで光を伝送する構成となっている。これにより、入力用導光体32は、発光素子31からの光をカンチレバー1の表面に向けて照射できるようになっている。

【0022】

レンズ33は、入力用導光体32からの光を集光してカンチレバー1の表面に照射する構成となっている。この実施形態では、レンズ33として平凸レンズが用いられている。

【0023】

受光部4は、レンズ41と、出力用導光体42と、受光素子43とを備えている。レンズ41は、二つの球形状レンズ411および412から構成されている。二つの球形状レンズ411と412との対向面は、ほぼ平面状に形成され、かつ、隣接して接合されている(図1参照)。

【0024】

出力用導光体42は、この実施形態では、2本の光ファイバ421および422によって構成されている。ただし、光ファイバの本数としては、1本とすることも、3本以上と

することも可能である。光ファイバ421の一端は、球形状レンズ411で集められた光を受け入れるようになっている。光ファイバ422の一端は、球形状レンズ412で集められた光を受け入れるようになっている。光ファイバ421および422の他端は、受光素子43まで延長されている。つまり、出力用導光体42は、カンチレバー1の表面で反射した光を受光素子43に導く構成となっている。

【0025】

受光素子43は、この実施形態では、二つのフォトダイオード431および432によって構成されている。フォトダイオード431は、光ファイバ421の他端に面する位置に配置されて、光ファイバ421からの光を受光するようになっている。フォトダイオード432は、光ファイバ422の他端に面する位置に配置されて、光ファイバ422からの光を受光するようになっている。受光素子43は、図示しない回路に接続されており、各フォトダイオード431および432での受光による出力をそれぞれ取り出すことができるようになっている。

【0026】

(実施形態の動作)

つぎに、前記のように構成された本実施形態のSPMの動作について説明する。まず、発光素子31を発光させる。これによる光は、入力用導光体32とレンズ33とを介してカンチレバー1の表面に照射される。カンチレバー1の表面で反射した光は、レンズ41と出力用導光体42とを介して、受光素子43に照射される。受光素子43では、受光量に応じた起電力が発生し、この起電力から受光量が算出される。

【0027】

この状態で、従来のSPMと同様に、試料に対して探針2を走査する。すると、探針と試料との相対移動に伴い、カンチレバー1の先端の位置が変化する。すると、カンチレバー1での光の反射角が変わり、レンズ41に入射する光の量が変わる。例えば、レンズ411への光量が増加し、レンズ412への光量が減少する。これにより、フォトダイオード431および432における起電力が変動する。この変動に基づいて、カンチレバー1の変位量（つまりAFMであれば試料の表面形状）を検出することができる。

【0028】

この実施形態では、出力用導光体42を用いているので、受光素子43をカンチレバー1から離間させることができる。すると、カンチレバー1を極低温や強磁場のような過酷な状況に置いても、受光素子43をその環境から隔離することができ、受光量の検出を精度良く行うことが可能となるという利点がある。つまり、過酷な環境下であっても、SPMを用いた測定が可能となる。

【0029】

さらに、この実施形態では、入力用導光体32により、発光素子31もカンチレバー1から離間している。このため、この実施形態では、カンチレバー1と、レンズ33と、入力用導光体32の先端と、レンズ41と、出力用導光体42の先端とを、発光素子31や受光素子43とは独立して移動させることが可能となる。このため、カンチレバー1を試料に対して移動させることが容易となるという利点がある。これにより、この実施形態のSPMによれば、試料を移動させる必要がなくなり、大きな試料を扱うことも可能になる。

【0030】

また、この実施形態では、二つの光ファイバ421および422を用いて、二つのフォトダイオード431および432に光を照射しているので、差動検出が可能となり、出力として得られる信号強度を高めることができる。つまり微少な光量変化の検出が容易となる。

【0031】

さらに、この実施形態では、二つの光ファイバ421および422を用いているので、一つの光ファイバを用いる場合に比較して、安定した測定が可能となる。すなわち、一つの光ファイバを用いた場合は、そのファイバで受光した光量の増減とカンチレバー1の変

位とを対応させることになる。しかしながら、これでは、外乱（例えば照射量自体の変化やノイズ）により誤差が発生する。また、カンチレバー 1 の変位がある程度以上に大きくなると、受光量の減少により、それ以上の変位を検出することができなくなる。この実施形態によれば、二つの光ファイバを用いているので、外乱を打ち消すことができ、一つの光ファイバを用いた場合に較べて、測定誤差を減少させることができる。さらには、この実施形態によれば、測定できるカンチレバー 1 の変位の範囲を増大させることもできる。

【0032】

また、この実施形態では、レンズ 41 として、二つの球形状レンズ 411 および 412 を用いているので、カンチレバー 1 からの反射光を光ファイバ 421 および 422 にそれぞれ集光させて入力することができる。しかも、両レンズ 411 および 412 の対向面が略平面状とされ、かつ隣接されているので、その設置空間を小さくすることができるという利点がある。

【実施例 1】

【0033】

前記実施形態の SPM を AFM として用いて、下記条件の下で測定を行った。結果を図 2 に示す。

【0034】

（測定条件）

コントローラ：JOEL 社製 JSTM4200D

光源：波長 680 nm のレーザダイオード（HL6738MG、日立製）

入力用導光体：シングルモード光ファイバ（FS-SN-3224、3M 製）

入力用レンズ：外径 1 mm の平凸レンズ（45589-E、Edmund industrial optics 製）

入力用レンズの焦点距離：約 3 mm

カンチレバー及び探針：AC-mode Si カンチレバー（NSC12C、 μ mas h 社製）

カンチレバーから受光用レンズまでの距離：約 3 mm

球形状レンズ（受光用）：45538-E、Edmund industrial optics 製を加工

出力用導光体：マルチモードファイバ（FIP100110125、Polymicro Technologies 社製）

受光素子：Si PIN フォトダイオード（S7797、浜松フotonクス社製を差動検出器として使用）

試料：SrTiO₃ 基板（単位格子ステップを有する）

試料の測定範囲：5 μ m \times 5 μ m

【0035】

この条件下において、図 2 に示されるトポ像を得ることができた。ステッパテラス構造が観察できる。測定できる振幅は、0.4 オングストローム以下も可能となっている。

【0036】

なお、本発明の走査型プローブ顕微鏡は、上記した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。

【0037】

例えば、レンズ 41 の代わりに他の集光機構、例えば透明な錐体を用いても良い。また、レンズ 41 を用いなくとも良い。この場合は、出力用導光体 42 の一端をカンチレバー 1 に十分近づける必要がある。

【0038】

同様に、レンズ 33 の代わりに他の集光機構を用いたり、その設置を省略することも可能である。後者の場合は、入力用導光体 32 の先端をカンチレバー 1 に十分近づける必要がある。

【0039】

レンズ 41 等の設置を省くことができれば、装置を小型化でき、光学系が単純となるので、カンチレバー 1 を試料に対して移動させることが一層容易となる。

【図面の簡単な説明】

【0040】

【図1】本発明の一実施形態に係る走査型プローブ顕微鏡の概略的な構成を示す説明図である。

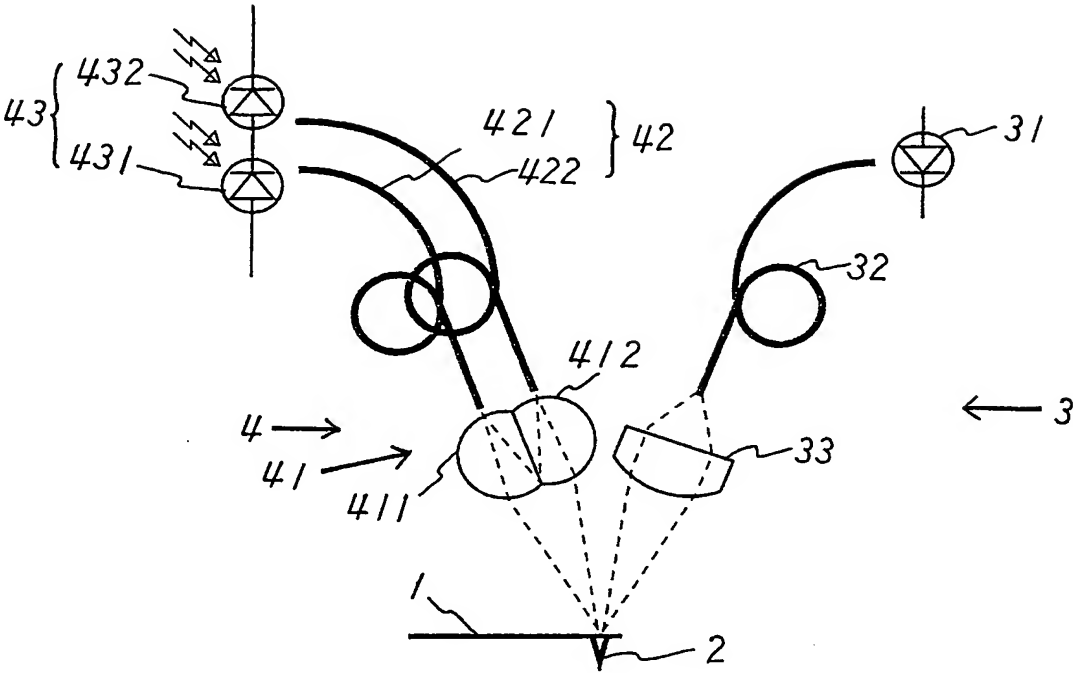
【図2】本発明の一実施例による測定結果を示す写真である。

【符号の説明】

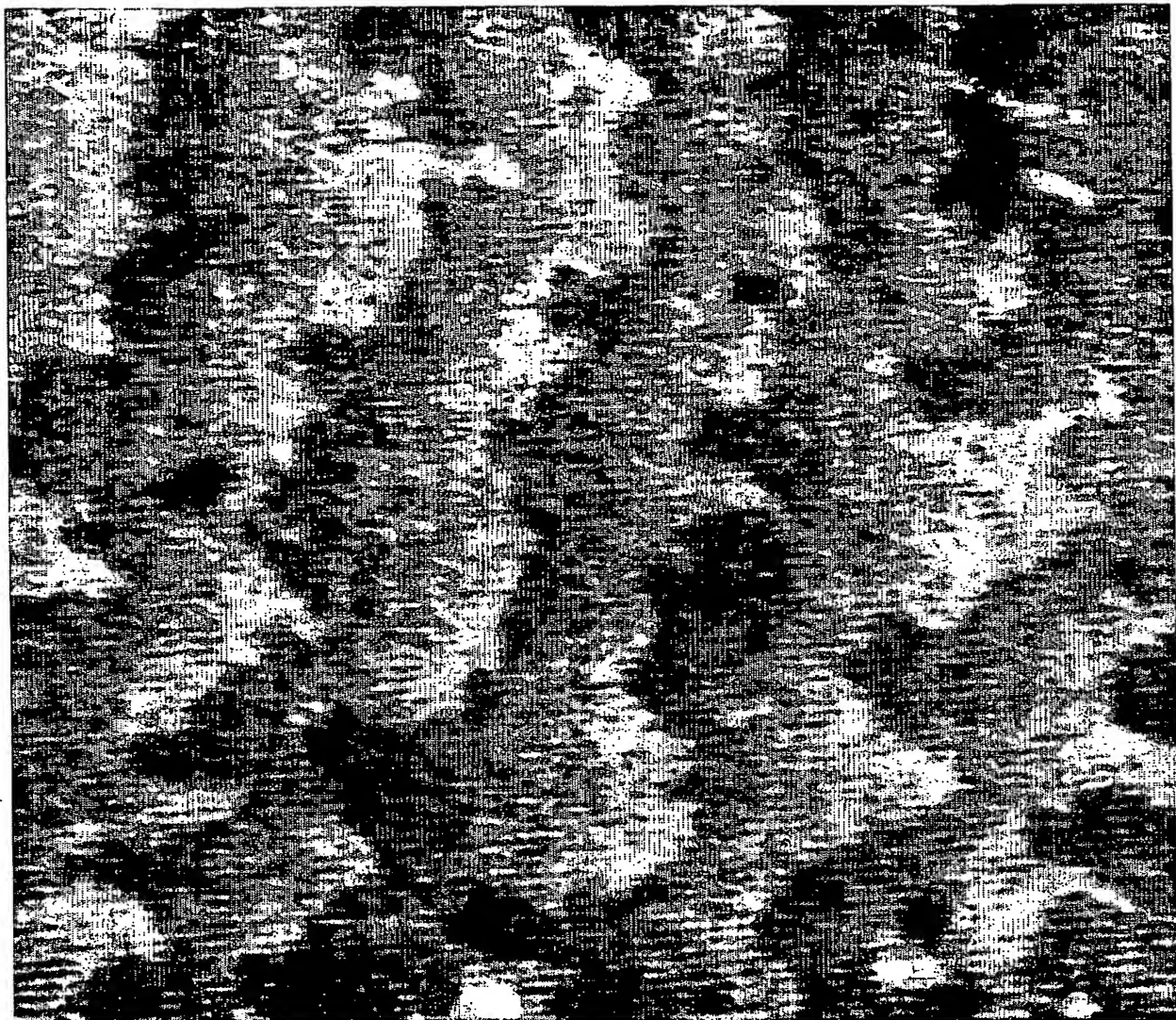
【0041】

- 1 カンチレバー
- 2 探針
- 3 発光部
 - 3 1 発光素子（レーザダイオード）
 - 3 2 入力用導光体（光ファイバ）
 - 3 3 レンズ
- 4 受光部
 - 4 1 レンズ
 - 4 1 1・4 1 2 球形状レンズ
 - 4 2 出力用導光体
 - 4 2 1・4 2 2 光ファイバ
 - 4 3 受光素子
 - 4 3 1・4 3 2 フォトダイオード

【書類名】 図面
【図 1】



【図 2】



BEST AVAILABLE COPY

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 厳しい環境下でも使用が容易な走査型プローブ顕微鏡を提供する。

【解決手段】 光ファイバ 3 2 は、レーザダイオード 3 1 からの光をカンチレバー 1 の表面に向けて照射する。照射された光は、レンズ 3 3 により集光されて、カンチレバー 1 の表面に照射される。カンチレバー 1 の表面で反射された光は、レンズ 4 1 1 および 4 1 2 により集光されて、光ファイバ 4 2 1 および 4 2 2 に入力される。光ファイバ 4 2 1 および 4 2 2 を通過した光は、フォトダイオード 4 3 1 および 4 3 2 により受光される。受光量の変化に基づいて、カンチレバー 1 の傾きを検出する。

【選択図】 図 1

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2003-281533
受付番号	50301251175
書類名	特許願
担当官	第一担当上席 0090
作成日	平成15年 8月 1日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成15年 7月29日

【書類名】 出願人名義変更届
【整理番号】 CAP03012
【あて先】 特許庁長官殿
【事件の表示】
【出願番号】 特願2003-281533
【承継人】
【識別番号】 899000024
【氏名又は名称】 株式会社東京大学 T L O
【承継人代理人】
【識別番号】 100091904
【弁理士】
【氏名又は名称】 成瀬 重雄
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 054391
【納付金額】 4,200円
【提出物件の目録】
【包括委任状番号】 0110003

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2003-281533
受付番号	50400952031
書類名	出願人名義変更届
担当官	小松 清 1905
作成日	平成 16 年 7 月 12 日

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成16年 6月 7日
【承継人】	
【識別番号】	899000024
【住所又は居所】	東京都文京区本郷七丁目3番1号
【氏名又は名称】	株式会社東京大学TLO
【承継人代理人】	申請人
【識別番号】	100091904
【住所又は居所】	東京都千代田区平河町2丁目3番11号 花菱イ マス平河町ビル4階
【氏名又は名称】	成瀬 重雄

特願 2 0 0 3 - 2 8 1 5 3 3

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [5 0 3 2 7 1 4 5 3]

1. 変更年月日	2 0 0 3 年 7 月 2 9 日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都三鷹市井の頭 1 - 2 4 - 3
氏 名	宮野 健次郎

特願 2003-281533

出願人履歴情報

識別番号 [503271682]

1. 変更年月日 2003年 7月29日

[変更理由] 新規登録

住所 東京都世田谷区三宿2-11-23 ルラシオン三宿302号

氏名 小川 直毅

特願 2 0 0 3 - 2 8 1 5 3 3

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [8 9 9 0 0 0 0 2 4]

1. 変更年月日 1 9 9 9 年 9 月 1 6 日
[変更理由] 新規登録
住 所 東京都千代田区丸の内一丁目 5 番 1 号 新丸の内ビルディング 6 階
氏 名 株式会社 先端科学技術インキュベーションセンター
2. 変更年月日 2 0 0 4 年 5 月 1 0 日
[変更理由] 名称変更
住所変更
住 所 東京都文京区本郷七丁目 3 番 1 号
氏 名 株式会社東京大学 T L O